

今回の目的

〇 センサの基礎

テーマ1:センサとは

・センサの役割 センサの例

センサを使う上での原則

テーマ2:センサを使うための基礎知識

・センサの性能を表す特性

センサの校正 (キャリブレーション)

センサの選び方

C06 センサの基礎

Page. 2 基礎からのメカトロニクスセミナー

イントロダクション

○ センサで何が測れるか

メカトロの対象となりそうな量は、「ほどほど」 には大抵のものを測る手段がある。

- ·位置/角度/速度/加速度/質量(重量)/力
- •温度/湿度/圧力(接触圧,油圧,気圧)
- ・光量(明るさ/色/波長)
- •電圧/電流/電力/抵抗/容量
- ・時間/周波数 (センサではないが) などなど (これは?という質問歓迎)

C06 センサの基礎

Page. 4 基礎からのメカトロニクスセミナー

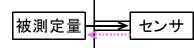
イントロダクション

○ センサで何が測れるか

メカトロの対象となるような量は、「ほどほど」 には大抵のものを測る手段がある。

問題は、

- どう測るか? (センサ選定、仕掛け)
- 十分な測定性能が得られるか?
- ・対象への影響は?
- ・コストは?



C06 センサの基礎

Page. 5 基礎からのメカトロニクスセミナ-

イントロダクション

〇 どう測るか?

例:流体の速さ

- ・風車/水車のようなものを流れに挿入
- ・流体と圧力の関係(ベルヌーイ、ピトー管など)
- ・音波の伝播時間やドップラー効果利用
- ・流体に奪われる熱量の測定(熱線流速計)
- ・磁界と運動と電流の関係 (電磁流量計)
- •マーカを入れてその移動観測
- •流量(も多様な方法)÷ 時間





Page. 7 基礎からのメカトロニクスセミナー

イントロダクション

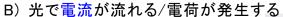
〇 何で測るか

本資料の画像の一部はWikipediaおよび 秋月電子通商サイトより引用しています

例: 光センサ

A) 光で抵抗値が変化

・CdSセンサ



- フォトダイオード →
 - ・フォトトランジスタ
 - ·CCD/CMOS撮像素子
- 光雷子增倍管



C06 センサの基礎

イントロダクション

○ センサで何が測れるか

メカトロの対象となるような量は、「ほどほど」 には大抵のものを測る手段がある。 ので、

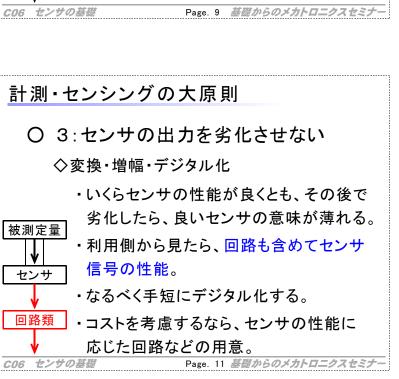
- 「〇〇を測るセンサ」の紹介は避け、 センサを使うとき/選ぶときに共通して 注意すべき点に注目。
- ・「こういうものを測るときには」は個別に 質問をお受けします。

C06 センサの基礎

Page. 8 基礎からのメカトロニクスセミナー

C06 センサの基礎

計測・センシングの大原則 ○ 1:センサの性能以上のことはできない ◇メカトロ制御の要はセンサ ・制御は「センサで拾う現在値」を 「目標」に一致させるように働く → 実際の値とセンサ出力に差があると、 それだけで制御の誤差になる。 → 計測できないものは制御できない。 回路類 ○ 1:センサ ・制御は「センサで拾う現在値」を 「目標」に一致させるように働く → 実際の値とセンサ出力に差があると、 それだけで制御の誤差になる。 → 計測できないものは制御できないが)



計測・センシングの大原則 ○ 2:センサと対象の確実な連結 ◇センサに現象を反映させる ・センサが対象と状態を共有すること。 例)接触式温度センサ(体温計等) 温度センサが対象と同じ温度に 暖まらないと、温度計測できない → 可能な限りしっかり結合 □路類 ・密着は必要ではないが、非接触センサに 確実に状態が伝わること。



○ 4:センサの用法をよく守る

◇センサは常に万全のコンディションではない

・センサがカタログ通りの性能を発揮する ためには、様々な条件がある。

| 被測定量 | 例)温度を一定に保つ | 振動を与えない | 高精度に一定の電源を供給

・補正可能な場合もあるが、限度がある。

C06 センサの基礎

回路類

C06 センサの基礎

Page. 12 基礎からのメカトロニクスセミナー

Page. 10 基礎からのメカトロニクスセミナー

〇 接触型 と 非接触型

◇接触型

対象に直接取り付ける。





対象に何らかの影響を及ぼしやすい。 例:一般的な温度センサ

◇非接触型

被測定量

・直接取り付けることなく測定する。



影響を及ぼさないことが一般的。

例:放射温度計、サーモグラフィー

C06 センサの基礎

Page. 13 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

〇 パッシブ型センサ

対))))セ

◇対象から「受けるだけ」のセンサ。

- 一般に構造が簡単=安い。
- ・ 消費電力は(同対象の能動型に比べ)低め。
- 複数のセンサを置いても干渉することは 少ない。
- ・対象から「出る特徴」がないと、測定できず。 例) 暗闇でカメラは使えない

C06 センサの基礎

Page. 15 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

- パッシブ(受動) と アクティブ(能動)
 - ◇パッシブ型
 - 対象から「受けるだけ」のセンサ。
 - ・多くのセンサがこれにあたる。 [対]))))セ
 - ◇アクティブ型
 - 何か対象に働きかけて、反応を見るセンサ。
 - ・例) 超音波距離センサ

C06 センサの基礎

超音波を発射→跳ね返る時間の計測

Page. 14 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

〇 アクティブ型センサ

◇何か対象に働きかけて、反応を見るセンサ。

- ・「測りやすいように」細工できるため、 パッシブでは困難な測定ができる。 例) ステレオビジョン VS Kinect
- アクティブ同士は干渉することがある。 例) 光パターン投影型の画像センサを複数使うと パターン同士が重なって干渉する。
- ・独特の使用制限:(例)日光下不可

C06 センサの基礎

Page. 16 基礎からのメカトロニクスセミナー

〇 デバイス・モジュール・装置

◇デバイス(部品)

- ・素のセンサ。通常は受動のみ。
- ・適切な処理回路を必要とする。
- ・部品コストは低め。(トータルでは ものによる)







C06 センサの基礎

Page. 17 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

〇 デバイス・モジュール・装置

◇装置

- ・処理部なども含めて箱に入れた物。
- ・「情報」(≠「信号」)を出力するものも多い。
- 扱いやすいが高価。



SICK社 レーザレンジ



HIOKI クランプオン 電流計

C06 センサの基礎

Page. 19 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

- 〇 デバイス・モジュール・装置
 - ◇モジュール・センサIC
 - ・センサデバイスに回路等加えたもの。
 - アクティブ型の部品状のもの。
 - ・単一部品にAD変換まで入れたものもある。







Page. 18 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

C06 センサの基礎

〇 出力の違いとその受け取り方

◇装置型

- ・出力は様々だが「しっかりとした」出力。 アナログ信号/デジタル信号(各種通信)/ オンオフ(シーケンサ用)
- ・つなぐという点では楽だが、動作設定が 複雑なものは多い。

(どちらかというとソフト的な作業。)

C06 センサの基礎

Page. 20 基礎からのメカトロニクスセミナー

〇 出力の違いとその受け取り方

◇モジュール型

- ・出力は様々だが「しっかりとした」出力。 アナログ信号/デジタル信号(各種通信)/ オンオフ(シーケンサ用)
- ・センサ部品の延長にあるため、生の信号 に近い。設定箇所は無く/少なく、処理は 利用者側が担当することが一般的。

C06 センサの基礎

Page. 21 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

〇 出力の違いとその受け取り方

◇部品型

- 「電気的変化」として様々なケースがある。
- ・出力は一般に弱く、回路の設計によって センサの性能が悪化する/使えない。 弱い:変化が小さい、影響を受けやすい、 電流が少ない(インピーダンスが高い)
- ・回路の精度の影響を受ける。

C06 センサの基礎

Page. 22 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

〇 出力の違いとその受け取り方

◇部品型:電圧出力型

・影響を考慮しつつ、増幅する。
 反転増幅 (電流が多少流れてもOK)
 非反転増幅・ボルテージフォロワ (電流が流れると困る場合)

差動増幅 (電圧差が出力される場合)

インスツルメンテーションアンプ

(電流流さず、電圧差を大きく増幅)

C06 センサの基礎

Page. 23 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

〇 出力の違いとその受け取り方

◇部品型:電流出力型(主に光センサ)

・電流変化を電圧変化にする。抵抗に流してその電圧 (簡易型)電流・電圧変換回路

電流センサ (大電流用、トランス、ホール)

C06 センサの基礎

Page. 24 基礎からのメカトロニクスセミナー

- 〇 出力の違いとその受け取り方
 - ◇部品型:抵抗変化型
 - 抵抗変化を電圧変化にする。
 - 一定の電流を流しておく
 固定抵抗と分圧回路を構成
 - ※ 流して良い電流に留意

C06 センサの基礎

Page. 25 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの種類

- 出力の違いとその受け取り方
 - ◇部品型(モジュール型):パルス出力型
 - ・被測定量に対応したパルス列が得られる センサがある。
 - a) ロータリーエンコーダ
 - b) 敢えてパルス列に変換して出力
 - ・マイコンのパルス計測系の入力端子に 接続する。

センサの種類

- 〇 出力の違いとその受け取り方
 - ◇部品型:容量変化型
 - ・発振回路などを用いて、周波数、周期変化 にした上で時間で処理する場合が多い。
 - ・固定周波数の信号を与えておき、その 流れ具合で評価する方法もある。

C06 センサの基礎

Page. 26 基礎からのメカトロニクスセミナー

今回の目的

〇 センサの基礎

テーマ1:センサとは

- ・センサの役割 センサの例
- ・センサを使う上での原則

テーマ2: センサを使うための基礎知識

- ・センサの性能を表す特性
- センサの校正 (キャリブレーション)
- ・センサの選び方

C06 センサの基礎

Page. 27 基礎からのメカトロニクスセミナー

C06 センサの基礎

Page. 28 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの性能を表す特性

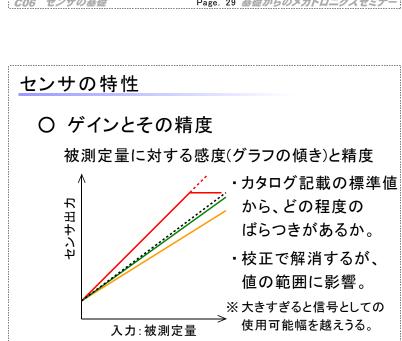
- 〇 センサの特性
 - 精度:オフセット/ゲイン/直線性
 - ・ヒステリシス
 - •応答性
 - ・ノイズ
 - 単調性
 - 再現性
 - •分解能
 - ・温度に依存する精度/ゼロドリフト

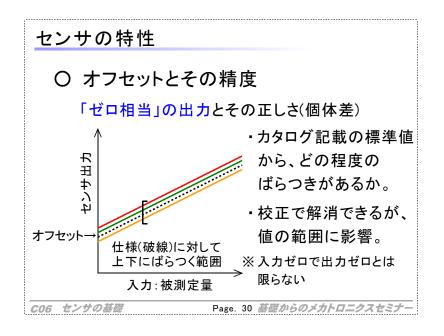
C06 センサの基礎

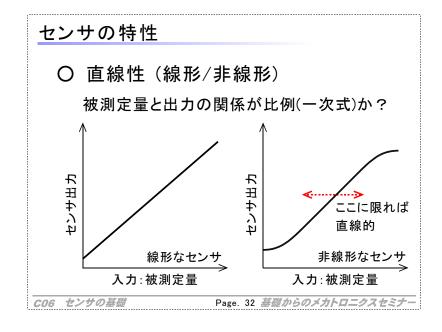
C06 センサの基礎

Page. 29 基礎からのメカトロニクスセミナー

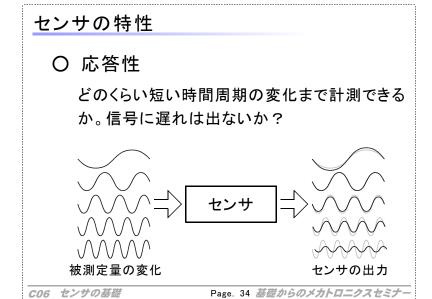
Page. 31 基礎からのメカトロニクスセミナー







センサの特性 O ヒステリシス 行きと帰りで異なる特性。 ・ 直流を扱うセンサ。 ・ メカ部のあるセンサや (ガタ、伸縮など) 磁気系のセンサで 見られること多い。 ・ 往復使用時に問題。 ー方向なら補正可。

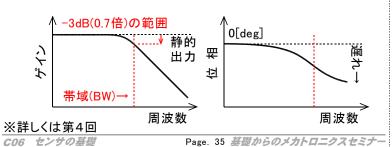


センサの特性

〇 応答性の表現:周波数応答

ある周波数の正弦波変化を与えたときに、

- ・ゲイン線図:被測定量と出力信号の比率
- ・位相線図:出力がどのくらい遅れるか



センサの特性

〇 応答性の評価

◇ゲイン:

- ・帯域が対象の時間変化をカバーするか。
- ・求める制御の速度より十分速いか。
- ・帯域でフラットな特性かどうか。

◇位相:

- ・使用範囲で妥当な遅れに収まっているか。
 - →「計測」ならあとで補正可、 「制御」だと要注意

C06 センサの基礎

Page. 36 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの特性

O ノイズ

どのくらい出力にノイズが混じっているか

- ・どれほど高精度なセンサでも大きなノイズ が混じっているとそのまま使えない。※信号処理で改善できることはある
- ・出力の小さなセンサは、増幅の過程で ノイズも増幅したり、ノイズが混入したり するので注意が必要。

※ただし特性値を理解するのは難しい

C06 センサの基礎

Page. 37 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの特性

C06 センサの基礎

〇 分解能

値をどのくらい細かく信じても良いか

単調なセンサ

入力:被測定量

- ・どのくらい小さな変化をとらえられるか。
- ノイズに埋まることなく取り出せるか。
- ・AD内蔵センサ: ADの分解能
- ・装置型:出力される値の分解能
- ・「分解能」と「精度」は別の物。

C06 センサの基礎

Page. 40 基礎からのメカトロニクスセミナー

単調ではない

Page. 38 基礎からのメカトロニクスセミナ

入力:被測定量

センサの特性 ○ 温度依存性/ゼロドリフト(オフセットドリフト) 温度によるゲインその他の特性の変化/ゼロ点(オフセット)の温度変化 「田本ハマール」 「温度高」 「中田・ハマール」 「温度高」 「根田・ハマール」 「温度高」 「根田・ハマール」 「被測定量は一定で

センサの校正

C06 センサの基礎

入力:被測定量

- センサの校正(キャリブレーション)◇原理
 - ・1個1個のセンサに、単調性と再現性があれば、センサの特性が非線形でも誤差があっても、補正ができる。
 - ・温度の影響を受けていても、その影響の 度合いが分かっていれば、温度センサを 併用することで補正することができる。

CO6 センサの基礎 Pag

Page. 43 基礎からのメカトロニクスセミナー

Page. 41 基礎からのメカトロニクスセミ

センサの特性

- 温度依存性/ゼロドリフト(オフセットドリフト)◇対策
 - ・温度センサを併用&温度も含めた 校正を行う。

(これを想定して、温度センサ入りのセンサもある)

- ・センサの温度変化を抑える。 (容器に入れる、断熱、一定温度に暖める)
- ・とくにゼロ点の重要なセンサ(積分する等) では注意が必要。

C06 センサの基礎

Page. 42 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの校正

- センサの校正(キャリブレーション)◇校正の一般的方法
 - ・「正確な」「基準となる」被測定量を 何通りか与える。
 - ・そのときの測定値を得る。 (コンピュータに取り込んで処理後の値)
 - ・正しい(既知の)被測定量→測定値 の関係を反対にして、使用時には 測定値→実際の被測定量

C06 センサの基礎

Page. 44 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの校正

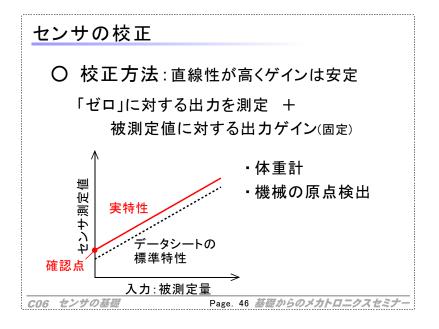
- 〇 校正の実例
 - ◇体重計(各種電子重量計)
 - ・電源を入れて数秒間、重量を測定して そこを「重さゼロ」とする。
 - ◇ロボット用姿勢センサ
 - ・静止/鉛直と見られるところでの測定値を 基準とする。
 - ◇ゲームコントローラ
 - ・最初に、指定された操作、動作を行う。

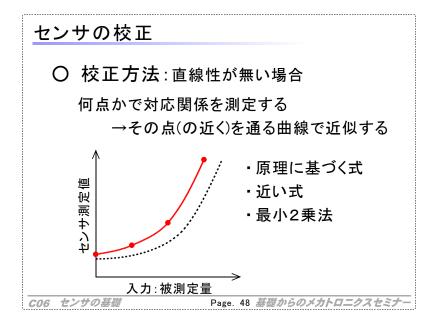
C06 センサの基礎

C06 センサの基礎

Page. 45 基礎からのメカトロニクスセミナー

Page. 47 基礎からのメカトロニクスセミナー





センサの校正 ○ 校正方法:直線性が無い場合 何点かで対応関係を測定する →区分した直線(曲線)で近似する ・演算が楽 ・複雑な形状を表し やすい ・「角」が出る課題 入力:被測定量 Rage, 49 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- なにを測りたいかを明確にする
 - ◇測定する量
 - ・対象とする物理量を明確にする。
 - ・対象そのものと関連する量をリストアップ:
 - 例)速度の測定= 速度(直接)/位置(微分)/加速度(積分) 傾斜角度の測定= 傾斜計(直接)/角速度ジャイロ(積分)/ 加速度(重力加速度の成分)

C06 センサの基礎

Page. 50 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- なにを測りたいかを明確にする◇測定する対象の制約
 - 主に注意すべきは大きさ。
 - =センサが取り付けられるかどうか、 センサを取り付けた影響がでないか
 - ・センサを取り付けることで生じる影響の 許容範囲。
 - =特に接触式は何らかの影響がでる

センサの選び方

- 〇 使えそうなセンサをリストアップ
 - ◇知識・体験ベース
 - ・いきなりネット検索しても「無事に使える」 ものを見つけることは難しい。
 - ・センサが使われている事例に普段から 興味を持って接すること、センサの製品 情報をみる、直接触ってみるなどが重要。
 - ・見当を付けた種類で絞り込んだ上で ネットでカタログ集め。

C06 センサの基礎

Page. 52 基礎からのメカトロニクスセミナー

C06 センサの基礎

Page. 51 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 〇 使えそうなセンサをリストアップ
 - ◇センサの使えるカタログ・使えないカタログ
 - ・必ずセンサのカタログ・データシートには 目を通す。
 - ・使えるカタログ: →いい例 データ(グラフ)がたくさん載っている、 使い方の回路例が載っている 等
 - ・使えないカタログ: →悪い例 「高性能です!」としか書いてない

C06 センサの基礎

Page. 53 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 〇 限界を知る
 - ◇入手できそうなセンサのうちで最高性能は?
 - ・「それ以上の性能は無理」 が設計要件を満たすかどうか。 満たさない場合は、設計と相談。
 - ※最悪のケースは断念
 - ※メーカに特殊グレードが無いか確認

C06 センサの基礎

Page. 54 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 〇 妥協点を検討する
 - ◇どこまで計測値の質を下げていいか?
 - 質を下げる余裕があるほど、コストや取り付け場所などの制約が楽に。
 - ・目標性能の面からの妥協。
 - ・回路のその他の「足をひっぱるところ」との比較。
 - ※もちろん、必要ならそちらを改善

センサの選び方

- 〇 選定する
 - ◇あとは選ぶだけ
 - 条件に合うものを選定。
 - ・ただしベストな1個だけではなく、複数を 検討しておく =カタログ通りに動かせない可能性
 - ※周辺回路、動作条件
 - ・実際にセンサ部だけ試作して動作チェック。

C06 センサの基礎

Page. 55 基礎からのメカトロニクスセミナー

C06 センサの基礎

Page. 56 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 〇 合成する/組み合わせる
 - ◇ここまでの選定は「世の中全て」の原則 ・メカやマイコンや、電子回路部品など
 - ◇加えて、センサは信号処理や合成して

改良できる

- 複数のセンサを使う=マルチセンサ
- ・複数種のセンサをつかう = センサフュージョン
- ・数をそろえて信号処理

C06 センサの基礎

Page. 57 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 合成する/組み合わせる
 - ◇センサフュージョンの例
 - 姿勢センサ

ジャイロ: 応答性〇 安定性× 加速度計: 応答性× 安定性〇

• 障害物検出

超音波測距:横に広がる、騒音に弱い レーザ距離:透明NG、反射物NG

→ ともに併用で欠点を減らす

C06 センサの基礎

Page. 59 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 〇 合成する/組み合わせる
 - ◇マルチセンサ+演算処理の例
 - マイクを複数並べる
 - →指向性マイク、音源探知
 - カメラを複数並べる
 - →ステレオビジョン(立体視)
 - カセンサを複数並べる
 - →重心位置が分かる
 - ※ 信頼性向上の場合も

C06 センサの基礎

Page. 58 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサの選び方

- 合成する/組み合わせる
 - ◇マルチセンサ、フュージョンを検討するには?
 - ・個々のセンサの長所短所を把握する。足りない何を付け加えたいのか、何で何を補うのか。
 - ・適切な信号処理法があるかどうか。 (含む処理のコスト)
 - ・センシングシステムとしての開発が必要。 ※いきなり実用というよりは研究開発型

C06 センサの基礎

Page. 60 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサ利用例

〇 市販のセンサを使う





姿勢センサ:

重面:

上位:

ファインダ

角速度ジャイロ

・ロータリーエンコーダ・レーザレンジ

・加速度(重力方向)

抵抗(電流検出)

C06 センサの基礎

Page. 61 基礎からのメカトロニクスセミナー

センサ利用例

ロ センサをつくる





3次元モーションキャプチャ

- 枠から交流磁界を発生
- 手元のコイルで拾う
- 位置姿勢を演算で求める

トレーラロボット用連結角センサ:

- ロータリエンコーダの原理
- ・薄いこと/耐荷重
- ・市販品に適当なものがない

C06 センサの基礎

Page. 62 基礎からのメカトロニクスセミナー

まとめ

〇 センサの基礎

- ・メカトロの対象になるような量には 測定できるセンサが大抵はある。
- 同じ対象の測定でも、原理から異なる 複数のセンサがあることも珍しくない。
- ・センサの性能以上の計測・制御は不可。
- ・部品、モジュール、装置などの形態がある。
- 受動型と能動型がある。

まとめ

〇 センサの性能・使い方・選定

- ・センサの選定において知っておくべき特性 オフセット/ゲイン/直線性/ヒステリシス 応答性/ノイズ/単調性/再現性/分解能 温度に依存性/ゼロドリフト
- ・一般に校正が必要。とくに絶対的な値を 得るためにはゼロ点の確認が必要。
- ・センサの選定は、物としての選定に加え、 処理まで含めた検討が望ましい。(→次回)

C06 センサの基礎

Page. 64 基礎からのメカトロニクスセミナー

C06 センサの基礎

Page. 63 基礎からのメカトロニクスセミナー